

導入年度	H 2 3 年度	設備名	ポータブル膜厚計		
メーカー	(株)フィッシャー・イン ストルメンツ	型 式	MMS PC2	設置室	機器分析室

平成23年度公設工業試験研究所の設備拡充補助事業(けいりんの補助金)

### 《 概 要 》

本装置は、めっき・塗装等表面にプローブを押し付けることにより非破壊で膜厚を測定します。

### 《 装置 》

外観



プローブ



### 《 仕様 》

- 1) 膜厚測定方式 : 磁気式、渦電流位相式
- 2) プローブ : EN3 プローブ、ESD20Zn プローブ
- 3) 測定可能膜種 : EN3 プローブ
  - ・ 非磁性材料上の Ni めっき皮膜
  - ・ 鉄素地上の非磁性皮膜 (硬質 Cr めっき、塗装、溶射、セラミックス等)
 ESD20Zn プローブ
  - ・ 磁性材料上の Zn、Cu めっき皮膜
- 4) 測定可能膜厚 : Ni/非磁性材料 (0~120 μm)、非磁性膜/Fe (0~4mm)、Zn/Fe (2~200 μm)、Cu/Fe (1~200 μm)
- 5) 装置サイズ : W360×D290×H175mm

### 《 用途例 》

- ・ めっきの膜厚測定 (Ni/Al、Cr/Fe、Zn/Fe など)
- ・ ホウロウ、溶射、塗装などの膜厚測定